TIN 付きのセラミックブレイクを利用した壁電流モニター TITANIUM NITRIDE-COATED CERAMIC BREAK FOR WALL CURRENT MONITORS WITH AN IMPROVED BROADBAND FREQUENCY RESPONSE

菖蒲田義博 *^{A)}、外山毅 ^{B)} Yoshihiro Shobuda^{*A)}, Takeshi Toyama^{B)} ^{A)}JAEA/J-PARC ^{B)}KEK/J-PARC

Abstract

The beam impedance of a ceramic break with thin titanium nitride coating (TiN) consists of resistive wall term caused by TiN, radiation term, and capacitive term made by the ceramic itself in parallel. The entire wall current continues to run in TiN even when the skin depth is much larger than the chamber thickness, except for the extremely thin TiN (typically below \sim nm). This characteristic is useful in developing a wall current monitor with an improved frequency response.

1. はじめに

金属製のチャンバーに挟まれた短いセラミックの リングを「セラミックブレイク」と呼ぶ。陽子シンク ロトロンの偏向電磁石付近では、外部磁場によって チャンバー上に生じる渦電流の影響を緩和するため セラミックブレイクをチャンバー間に挿入する[1]。 また、陽子ビームの一部がチャンバー内面に衝突す ることで生じる電子の二次放出を抑制するため、こ のセラミックブレイクの内面は、数 10nm 程度の薄 い窒化チタン (TiN)を施されることもある [2-4]。

陽子シンクロトロンで大強度ビームを実現する ために、このようなセラミックブレイクが作るビー ムのインピーダンス [5-7] は精力的に研究されてき た [8-10]。現在、このインピーダンスは、セラミッ クブレイクからの放射損失、セラミックが作る容量 項、及び TiN が作る抵抗の並列回路で近似できるこ とが分かっている [10]。この時、TiN の厚さを薄く するとインピーダンスは高くなる。それは、スキン デプスが TiN の厚さより大きい低周波領域では壁電 流は TiN のみを流れようとし、その直流抵抗を感じ るからである。これは、セラミックブレイクのイン ピーダンスが、広帯域で周波数に依存しなくなるこ とを意味している。

従って、薄い TiN を施したセラミックブレイクを 使うと縦方向のビーム形状を精度良くモニターでき る。本報告では、主に理論と測定の観点から上記の 原理の実証試験結果を説明する。

2. セラミックブレイクのインピーダンス

長さ g の セラミックブレイクを考える。セラミッ クの比誘電率を ϵ' , 厚さ t の TiN の導電率を σ_{TiN} 、 セラミックブレイクの外半径と内半径を a_2 と a で 与えた時、低周波 ($f < c/\pi g$) では、セラミックブ レイクのインピーダンス $Z_{cerTiN,L}$ は次のように近 似される [10]。

$$\frac{Z_{cerTiN,L} \simeq}{\frac{1}{\frac{j\omega a_2(J+Y)}{cZ_0} - \frac{j2\pi c a_2 \kappa_{TiN} \tanh \kappa_{TiN} t}{g\omega Z_0} + \frac{j2\omega \epsilon' \pi a_2(a_2-a)}{cZ_0 g}}}.$$
(1)

ここで、fは周波数、cは光速、jは虚数単位、 $\omega = 2\pi f$ 、 $Z_0 = 120\pi$ 、

$$\kappa_{TiN} = \sqrt{\frac{j\omega Z_0 \sigma_{TiN}}{c}}.$$
 (2)

Equation (1) の分母の第1項はチャンバー内(Jに比例する項)と外部自由空間(Yに比例する項)に向かう放射損失由来の項、第2項は、TiN由来の抵抗 性アドミッタンス、第3項はセラミックに起因する 容量性アドミッタンスを示している。第2項は高周 波側で抵抗性インピーダンスを再現し[5]、低周波側 で直流抵抗を再現する。この式の構造から、ビーム のエネルギー損失上有利である限り、TiNを薄くし ても、壁電流は実効的にTiN上を流れ続けることが わかる。

なお、数 10nm 程度の薄い TiN を持つセラミック ブレイクのインピーダンスを数値的に求めるには、 非常に小さなメッシュサイズが必要となるため、こ の手法は一般に不適当である。セクション3では、 その手法の限界の一旦を示す。

3. インピーダンスの測定

TiN を施した長さ 10mm のセラミックブレイクの インピーダンスを測定する。そのため、セラミックブ レイクを長さ 470mm の SUS チャンバー (a = 65mm, $a_2 = 70$ mm) で挟み、その両端を 242.85mm のテー パー管でさらに挟んだ。内部導体をチャンバーの中 央に配置し、特性インピーダンスが $Z_{50}(=50 \Omega)$ に なる同軸構造を作った。テーパー管の電圧定在波比 (VSWR) は 1GHz まで 1.1 以下である [11]。また、 チャンバーの上下流側のポートはネットワークアナ ライザ [12] のポート 1、2 に接続した。

^{*} yoshihiro.shobuda@j-parc.jp



Figure 1: Schematics (left) and the photos (right) of the measurement setups.



Figure 2: Measurements (left) and theoretical (right) results of the longitudinal impedance. The horizontal axis is frequency in logarithmic scale.

Figure 1 の左図は、右の写真に対応するセラミック ブレイクのセットアップの模式図である。上段の図 では、セラミックブレイクは金属製の台の上で絶縁 体(緑色)によって支えられ、TiN にのみ壁電流が流 れる。一方、下段では、壁電流は TiN と金属台両方 に流れる。インピーダンスの測定では、上図のみ考 える。以後、壁電流に対するセラミックブレイクの 「電気的なインピーダンス」は *Z_{TiN}* と書く。

測定結果 (左) と理論結果 (右) (t = 10nm、 $\sigma_{TiN} = 3.5 \times 10^6$ [S/m] と仮定した。)を Fig. 2 に示す。右図 の赤と青は $Z_{cerTiN,L}$ の実部と虚部である。左図で $Z_{cerTiN,L}$ (赤/青)と Z_{TiN} (黒/緑)の (実部/虚部)を

$$Z_{cerTiN,L} = -2Z_{50} \log[\frac{S_{12}}{S_{12}^{(ref)}}],$$
(3)

$$Z_{TiN} = 2Z_{50} \frac{\left(1 - \frac{S_{12}}{S_{12}^{(ref)}}\right)}{\frac{S_{12}}{S_{12}^{(ref)}}},$$
(4)

に従って計算した [7,13,14]。但し、S₁₂ と S₁₂^(ref) は、 セラミックブレイクの場合とそれを銅のパイプに置 き換えた場合の S 行列の 1,2 成分である。両者の実 験結果の差は無視できる。それは、この周波数領域 では、セラミックブレイクのサイズ 10mm が、波長 に比べて十分小さいためである。また、高周波側の 振動を除き理論は測定結果を説明できる。この振動 は、テーパー管とそれに挟まれる中央同軸管とのイ ンピーダンス・ミスマッチに起因する系統誤差と推 定される。



Figure 3: Simulations of the longitudinal impedance without (left) and with (right) tapers in the setup shown in the upper figures. The horizontal axis is frequency in logarithmic scale.

この推論を裏付けるため、'tabulated surface impedance' 模型を使って、CST [15] で数値計算を行 うことにする。まず、テーパーを無視した場合の数値 計算結果をFig. 3 の左図に示す。赤と青は,それぞれ インピーダンスの実部と虚部を示す。実部は,(理論 値/測定値)の1.85 倍となっているものの一定値を示 す。この不一致の原因は、'tabulated surface impedance' 模型が1層1次元模型のためと推定される。また、 虚部は、セラミックの効果で容量性になっているよ うに見える。しかし、これは偶然である。'tabulated surface impedance' 模型は、「不透過性」の材料を仮定 するので、原理的に TiN の外側の効果をシミュレー トできないことに注意が必要である。

このような数値計算手法の持つ限界を認識した上 で、テーパー管の影響を数値計算に含めてみる。テー パー管は、1GHz まで VSWR が 1.1 以下という条件 を満たすようにモデル化した。Figure 3 の右図の数 値計算結果は、Fig. 2 の左図の測定結果と同じ振幅 0.2 Ωの振動を示している。この結果は、「振動は、イ ンピーダンス・ミスマッチに起因する。」という当初 の推論を間接的に裏付けている。

最終的に Fig. 2 から言える重要な結論は、イン ピーダンスが周波数に大きく依存していないこと。 そして、以下のような厚みを持つ抵抗性チェンバー のインピーダンスに従わないことである [5]。

$$Z_{res} = gZ_0 \frac{(1+j)\sqrt{\frac{2\omega}{cZ_0\sigma_{TiN}}} \tanh[(1+j)\sqrt{\frac{\omega\mu_0\sigma_{TiN}}{2}}t]}{4\pi a}.$$
(5)

ビーム形状とセラミックブレイク上の 信号の関係

4.1 測定設定

次にチャンバーに入射した電流(ビーム)パルス が、セラミックブレイク上でどのようにモニターさ れるか調べる。Figure 4 に 2 種類の測定のセットアッ



Figure 4: Schematic of the measurement setups to observe the relation between the voltage V_2 on the ceramic break and the pulse signal V_1 on the inner conductor.

プを示す。左が時間領域での右が周波数領域での セットアップである。

左図では、テーパー管の上流側のポートがパルス ジェネレーター [16] に接続されており、パルス電 圧モジュール (PVM-1001 [17]) で、入力振幅は最大 1kV まで増幅される。測定では 60ns のフラットトッ プタイムを持つ、立ち上がり時間が 5ns、立ち下がり 時間が 5ns のパルスを発生させた。テーパー管の下 流側のポートは、アッテネータ [18] を介してオシロ スコープ [19] に接続する。セラミックブレイク上に は、BNC コネクタを取り付ける。Figure 4 右図の拡大 図のように、TiN、上流側と下流側の両チャンバー、 BNC コネクタのインナー/グラウンドを電気的に接 続する。セラミックブレイク上のポートはオシロス コープに接続して、その電圧を観測した。

Figure 4 の右図では、チャンバーの上流側のポート を Z₅₀ の整合抵抗で終端する。チャンバーの下流側 のポートはネットワークアナライザのポート1に接 続し、セラミックブレイク上のポートはネットワー クアナライザーのポート2に接続する。この測定に より、チャンバーの下流側のポートと、セラミックブ レイク上のポートの関係を周波領域で理解できる。

Figure 4 の右図の S 行列成分を $S_{12}^{(mon)}$ 、Fig. 4 の左 図のチャンバーの下流側のポートと、セラミックブ レイク上のポートの電圧のフーリエ成分を \tilde{V}_1 、 \tilde{V}_2 、 lをセットアップの全長、L と Cをセットアップの 同軸構造が作る単位長さあたりのインダクタンスと キャパシタンスと書くと、 $Z_{50} \gg Z_{TiN}$ の場合 \tilde{V}_1 、 \tilde{V}_2 の関係は

$$-\frac{e^{-j\omega\sqrt{LC}\frac{l}{2}}\tilde{V}_{2}}{\tilde{V}_{1}}\simeq e^{j\omega\sqrt{LC}\frac{l}{2}}S_{12}^{(mon)},$$
 (6)

と近似される [20]。さらに、セラミックブレイク上 のポートの BNC に付随するインピーダンスが無視 できる場合は、

$$-\frac{e^{-j\omega\sqrt{LC}\frac{l}{2}}\tilde{V}_2}{\tilde{V}_1} \simeq \frac{Z_{TiN}}{Z_{50}},\tag{7}$$

と簡単化される [20]。ここで、Eq. (6)、(7) の左辺の 指数関数因子とマイナス記号は、チャンバーの下流 端とセラミックブレイク上のポート端間の時間差、 及び BNC 端子のセットアップ条件に由来する信号 極性を表している。

なお、指数関数因子は、セラミックブレイク上の ポート端を Z_{50} で終端し、ネットワークアナライザー のポート2をチャンバーの上流端につなぎ変えた後、 測定したS行列成分 (($S_{11}^{(thr)}, S_{12}^{(thr)}$), ($S_{21}^{(thr)}, S_{22}^{(thr)}$)) を用いて、

$$e^{j\omega\sqrt{LC}\frac{l}{2}} = \pm \frac{1}{\sqrt{S_{11}^{(thr)} + S_{12}^{(thr)}}},\tag{8}$$

と求められる。ここで、符号 \pm は、指数関数因子の 引数の虚部 ($\omega\sqrt{LCl}/2$) が、正の値となるように決 める。

4.2 測定結果



Figure 5: The signal at the downstream end of the chamber (left) and the monitored signal on the ceramic break (right).

チャンバーの下流側ポートとセラミックブレイク 上のポートで信号を観測した結果を Fig. 5 に示す。 セラミックブレイク上の信号(右)は、チャンバー の下流側ポートの信号(左)をよく再現する。また、 両者の最大値の比は

$$\frac{g}{\sigma_{TiN}2\pi atZ_{50}}\simeq 0.014,\tag{9}$$

で求められ、Eq. (7)と無矛盾である。

さらに、測定データが Eq. (6) を満たすかを調べ た。まず、オシロスコープの観測結果をフーリエ変 換し、Eq. (6) の左辺を算出した。次に、ネットワー クアナライザで観測した S^(mon) を Eq. (6) の右辺に 代入した。Figure 6 に Eq. (6) の右辺と左辺を示す。 赤 (実線) と青 (破線) は右辺の実部と虚部を、紫 (実 線) と縁 (破線) は左辺の実部と虚部を示す。実部虚 部共 100MHz 以下ではよく一致するが、高周波側で 一致が悪くなる。これは、オシロスコープで測定し たパルスの時間領域の精度が不足するためである。

今回の測定では8ビットの垂直分解能をもつオ シロスコープで帯域幅を500MHzに、サンプリング レートを5GS/sに設定した。また、データは100回の 平均をとった。ところが、Fig.7が示すように、入力



Figure 6: Comparison between the left- (purple/green) and right-hand (red/blue) sides of Eq. (6) for the ceramic break in the upper figures of Fig. 1.

パルスのフーリエ成分の絶対値 $|\tilde{V}_1|$ は 100MHz 付近 を超えると急激に減少する。そのため、有意なデー タは 100MHz 以下に制限される。原理的には、入力 パルスを δ 関数に近づけることで有効周波数範囲を 広げることができるが、現在のパルス発生器 [16] の 立ち上がり/立ち下がり時間の最小値は 5ns である。



Figure 7: Normalized Fourier transformed current pulse $|\tilde{V}_1(f)|/|\tilde{V}_1(f=0)|$.



Figure 8: Amplitude (left) and phase (center/left) of $S_{12}^{(mon)}$ for the ceramic break in the upper figure of Fig. 1, where the right figure is a scaled-up figure of the center figure from 0 to 200 MHz.

次にネットワークアナライザを用いて、4.5GHz ま で $S_{12}^{(mon)}$ の特性を直接観測した。Figure 8 は、 $S_{12}^{(mon)}$ の振幅(左)と位相(中央/右)を示したもので、右 図は中央図の0~200MHzの拡大図である。中央図 と右図の青線は、: $-2\pi f \sqrt{LCl}/2$ を示している。振幅の一様性と位相の直線性は 2.5GHz 付近まで良好である。(指数関数型 [21]、三角型と五角型 [22] などの)電極型モニターでは $S_{12}^{(mon)}$ の振幅はf = 0から

増加するので、この点では TiN を施したセラミック を応用した本モニターの周波数特性は優れていると 言える。



Figure 9: Amplitude (left) and phase (center/left) of $S_{12}^{(mon)}$ for the ceramic break in the lower figures of Fig. 1, where the right figure is a scaled-up figure of the center figure from 0 to 200 MHz.

次に、Fig. 1の下段のセラミックブレイクを考え る。この場合、金属製の台の影響で壁電流の経路が 変形する。Figure 9 に、 $S_{12}^{(mon)}$ の振幅 (左) と位相 (中 央/左)の測定結果を示した。この場合も 2.5GHz 付近 までは、振幅の一様性と位相の直線性は良好である。 但し、Fig. 8 と比較すると $|S_{12}^{(mon)}|$ はわずかに減少 し、 $arg[S_{12}^{(mon)}]$ は低周波でわずかに増加す(誘導的 にな)る。



Figure 10: The signal at the downstream end (red) of the chamber and the monitored signal (blue) on the ceramic break in the lower figure of Fig. 1.

Figure 10 は、このわずかに変調した S^(mon) の振幅 と位相がモニターされたパルスに与える影響を時間 領域で表したものである。パルスの頭頂部が欠け、 テールは減少した後、約 1µs でゼロに回復している。 そこで、Eq. (6) を利用して、モニターされたパル スを次のように校正する。

$$\mathcal{V}_{1,c}(t) = -\int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} \frac{e^{j\omega(t-\sqrt{LC}l)}\tilde{V}_2}{S_{12}^{(mon)}} W(\omega).$$
(10)

ここで、 $\mathcal{V}_{1,c}(t)$ は校正されたパルス、 \tilde{V}_2 はオシロス コープで観測された電圧のフーリエ成分、 $W(\omega)$ は 以下のような

$$W(\omega) = \begin{cases} 0.54 - 0.46 \cos(\pi (\frac{\omega}{2\pi win} - 1.0)), \\ \text{for } 0 \le \frac{\omega}{2\pi win} \le 1, \\ 0, \text{ otherwise}, \end{cases}$$
(11)

窓函数である [23]。但し、win は台形ビームパルス で決まるウィンドウパラメータで、(今は立ち上がり 時間が 5ns なので)、200MHz と選んだ。Figure 11 を みると、パルスの頭頂部とテール部の歪みが回復し、 $\mathcal{V}_{1,c}(t)$ は Fig. 10 の赤線を再現する。



Figure 11: Reproduced current signal by using the monitored signal.

5. まとめ

数 10nm 程度の薄い TiN を施したセラミックブレ イクのインピーダンスを考えた時、数値計算による アプローチにはいくつかの欠点があり、正確には記 述できない。そこで、本報告ではまず、理論と測定 の観点からこの特性を解明した。理論的には、セラ ミックブレイクのインピーダンスは TiN に起因す る抵抗、放射損失項、およびセラミック自体に起因 する容量項の3つの成分の並列回路で記述できる。 そして、スキンデプスが TiN の厚みより大きい周波 数領域では、壁電流は TiN の中を流れ続ける。これ は、セラミックブレイクのインピーダンスが周波数 に強く依存しなくなることを意味する。実際の測定 でも、ビームのインピーダンスは、非常に低周波側 から GHz 領域に渡るまで、TiN の直流抵抗で記述で きることが確認できる。

この特性は、広帯域の周波数特性を持つ壁電流モ ニターの開発に役立つ。電流(ビーム)パルスとセラ ミックブレイク上のモニター信号は Eq. (6) に従うの で、その周波数特性は S₁₂^(mon) で理解できる。測定で は、セラミックブレイクのモニターは良好な S₁₂^(mon) の振幅の一様性と位相の直線性を 2.5GHz 付近まで 示した。実際のセラミックブレイクは、金属製の台 の影響のため、モニター信号はインダクティブな効 果で歪むが、Eq. (6) を利用するとそれは校正できる。

一般に電極型(指数関数電極、三角電極、五角形電 極)のモニターでは、|S^(mon)|は周波数に対してゼロ から増加するので、モニターは電流(ビーム)パルス の微分波形を出力する。これに対し、セラミックブ レイクを利用したモニターは、周波数に対し |S^(mon)| は一定になるので、電流(ビーム)パルス形状を直 接出力できる。

謝辞

JAEA/KEK の J-PARC プロジェクトのメンバー の皆様に感謝いたします。本研究は KAKENHI (17K05124)の支援を受けて行われたものです。

参考文献

- [1] Y. Shobuda, Y. Irie and S. Igarashi, Phys. Rev. ST Accelerators and Beams, **12**, 032401 (2009).
- [2] K. Ohmi, T. Toyama and C. Ohmori, Phys. Rev. ST Accelerators and Beams, 5, 114402 (2002).
- [3] K. Ohmi, T. Toyama and C. Ohmori, Phys. Rev. ST Accelerators and Beams, 6, 029901(E) (2003).
- [4] Y. H. Chin et al., in Proc. 39th ICFA Advanced Beam Dynamics Workshop on High-Intensity and High-Brightness Hadron Beams (HB'06), Tsukuba, Japan, 2006, TUBX01, pp. 125–127.
- [5] A. W. Chao, *Physics of collective beam instabilities in high energy accelerators*, (Wiley, New York, 1993).
- [6] B. W. Zotter and S. A. Kheifets, *Impedances and wakes in high-energy particle accelerators*, (World Scientific, Singapore, 1998).
- [7] Handbook of Accelerator Physics and Engineering edited by A. W. Chao and M. Tigner, (World Scientific, Singapore, 1999).
- [8] Y. Shobuda, Y. H. Chin and K. Takata, Phys. Rev. ST Accelerators and Beams, 10, 44403, (2007).
- [9] Y. Shobuda, Y. H. Chin and K. Takata, Phys. Rev. ST Accelerators and Beams, 12, 094401 (2009).
- [10] Y. Shobuda, Y. H. Chin and K. Takata, Phys. Rev. ST Accelerators and Beams, 17, 091001 (2014).
- [11] NIKOHA, https://www.nikoha.co.jp/coax_component/ cat01_class07/1228.html
- [12] Agilent Technologies, Now, Keysight Technologies, https://www.keysight.com/jp/ja/home.html
- [13] H. Hahn and F. Pedersen, BNL50870, (1978)
- [14] H. Hahn, Phys. Rev. ST Accelerators and Beams, 3, 122001, (2000)
- [15] CST STUDIO SUITE, http://www.cst.com
- [16] https://www.tek.com/ Tektronix, KEITHLEY 3390 50MHz Arbitrary Waveform Generator
- [17] https://www.digikey.com/product-detail/ en/directed-energy-inc/PVM-1001-P/ 2145-PVM-1001-P-ND/10268386
- [18] http://www.tmele.jp/english/, Tamagawa Electronics Co. Ltd, UFA-100NPJ-20
- [19] https://www.tek.com/ Tektronix, DPO 5054 Digital Photosphor Oscilloscope
- [20] Y. Shobuda and T. Toyama, Phys. Rev. Accelerators and Beams, 23, 092801, (2020).
- [21] T. P. R. Linnecar, CERN ReportNo. CERN-SPS-ARF-SPS/78/17, 1979; T. P. R. Linnecar, IEEE Transactions on NS-2626, 3409 (1979).
- [22] Y. Shobuda, Y. H. Chin, K. Takata, T. Toyama, and K. Nakamura, Phys. Rev. Accelerators and Beams, 19, 021003, (2016).
- [23] G. Harris, Proc. IEEE 66, 51, (1978).